

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ ВЫПУСКА

С 9 по 13 сентября 2002 года в г. Новосибирске проходил 7-й Международный симпозиум по лазерной метрологии – LM-2002. Организаторами Симпозиума выступили Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН и Институт лазерной физики СО РАН. Симпозиум проведен по инициативе Международной конфедерации по измерениям (IMEKO) под эгидой Технического комитета по измерениям геометрических величин (TC-14).

В работе Симпозиума приняли участие 193 ученых из научных и промышленных организаций России и зарубежных стран: из них 45 – ведущие специалисты научных центров Австрии, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Японии, Чехии, Польши и других стран.

Научная программа Симпозиума охватывала широкий спектр современных проблем метрологии: фундаментальная лазерная метрология; микро- и нанометрология; метрология лазерных измерений; 3D-контроль и метрология; измерение геометрических параметров; поверхностные измерения; измерения размеров и управление качеством продукции; оптико-волоконные датчики; оптические методы исследования потоков; методы интерференции в измерениях; лазерные и оптические измерения в научных исследованиях; применение оптики и лазеров в повседневной жизни; инновационные компоненты, техника и методы; измерения на основе фотоники и их применение в медицине и биологии.

Редколлегия журнала и программный комитет Симпозиума рекомендовали для опубликования в журнале «Автометрия» статьи на основе ряда докладов, представленных на Симпозиуме. Настоящий тематический выпуск посвящен актуальным проблемам оптико-электронных измерительных технологий, разработке интеллектуальных информационно-измерительных систем для научных и промышленных применений.

В разделе, посвященном информационно-измерительным системам, представлены материалы по системам контроля геометрических характеристик трех- и двумерных микро- и макрообъектов, комплексному применению фотометрического и спектрального анализа в медицине, а также по оригинальному использованию многолучевой интерференции.

Раздел оптических информационных технологий, элементов и систем охватывает проблематику использования адаптивной оптики, волоконно-оптической интерферометрии, корреляционного анализа спектральных изображений, применения эксимерных лазерных систем и нелинейно-оптических методов в системах управления, контроля и диагностики.

Материалы данного выпуска могут быть интересны специалистам в областях оптических измерений, разработки оптико-электронных измерительных систем и технологий.

Д-р техн. наук Ю. В. Чугуй